

令和6年3月 日

超顕微解析研究センター
課題申請者各位

九州大学超顕微解析研究センター
センター長 村上 恭和

電顕利用報告書並びに来年度申請書類の提出につきまして

日頃より超顕微解析研究センターをご利用いただき有難うございます。
つきましては年度末を迎えましたので貴殿の申請課題について下記変更点をご確認いただき、
報告書等の提出をお願い致します。

記

【1】 令和6年度 課題申請書（様式1） ※令和6年度も利用される場合のみ

(超高圧利用者は実験計画書も)

令和6年3月29日(金)

※以降随時受付

【2】 講演発表件数及び発表論文リスト（様式2）

令和6年3月29日(金)

【3】 研究報告 No.48 の掲載論文（様式3-1, 3-2）

令和6年5月17日(金)

【4】 電顕に関連した学位取得・受賞情報（様式4）

令和6年5月17日(金)

全てメールでのご提出をお願いいたします。

※詳細は次ページよりご確認ください

提出先

伊都キャンパス 超顕微解析研究センター 事務室

Mail: hvem_office@hvem.kyushu-u.ac.jp 内線: 90-3292

全ての様式は HP からもダウンロードできます <http://www.hvem.kyushu-u.ac.jp>

【1】課題申請書 (様式 1)

課題申請の有効期限は本年 3 月 31 日ですので、利用を継続される方は来年度の課題申請書を、ご提出ください。

■ 課題申請書の押印は不要です

■ 1 枚の課題申請書で、財源を 3 つまで申請できます

◆ 年度の途中で財源を追加することも可能です。

◆ 3 月のお支払いは原則として「授業料/自己収入」もしくは「寄付金」となります。(次年度予算からの引き落とし) 3 月にご利用の可能性のある場合はご記入ください。

尚、超高压電子顕微鏡を利用予定の方は、X線発生装置実験計画書も提出してください。

【2】講演発表件数及び発表論文リスト(様式 2)

* 令和 5 (2023) 年講演発表件数 (件数のみで結構です)

- 電頭を利用したもので令和 5 (2023) 年 (1 月~12 月) に発表したものとします。

* 令和 5 (2023) 年発表論文リスト

- 電頭を利用したもので令和 5 (2023) 年 (1 月~12 月) に掲載されたものとします。
(受理済みや印刷中のものは除いてください)

- 外字や専用文字は使用しないでください

本報告では JIS 漢字 (第 1、第 2 水準) を利用します。JIS 漢字に含まれない特殊な文字を氏名に利用されている外国人の方は、英語、もしくはカタカナでの表記をお願い致します。(詳しくは下記「論文リスト作成上の注意」参照)

〈論文リスト作成上の注意〉

(1) 形式は次の通りとする

論文題目

著者名 (表記は **K. Yasuda** / **安田和弘** に統一してください)

誌名、巻号(年)、ページ (ただし、号は省略可)

(2) 著者の所属は記入しない

(3) 省略形は一般的に用いられているものを使用する

— 邦文では

九州大学工学集報等 → 九大工学集報

— 英文では—冠詞・前置詞は省略してよい

Proceedings → Proc. International → Int.

Congress → Cong. Journal → J.

Bulletin → Bull. Physics → Phys.

Journal of Microscopy → J. Microscopy

【3】 「超顕微解析研究センター報告」 第 48 号に掲載する原稿 (様式 3-1, 3-2)

「超顕微解析研究センター報告」 第 48 号を発行いたしますので、研究報告を執筆要項に従って提出してください。また、原稿提出は Word ファイルと PDF ファイルの 2 つを E-mail に添付してお送りください。

※学会誌等への発表と内容的重複は差し支えありません。申請課題数に関係なく、何編でも結構です。(但し、本年度電頭を一度も利用していない方は研究報告書を提出する必要はありません。)

※海外の大学・研究所へも送付しておりますので、できるだけ英語 (様式 3-1) での執筆をお願い申し上げます。

〈研究報告書の原稿執筆要領〉

1. 「超顕微解析研究センター報告」の編集方針は次の通りです。

(1) 「超顕微解析研究センター報告」は九州大学超顕微解析研究センターにおける研究活動の紹介を主な目的とし、超顕微解析研究センター運営委員会が編集し、発行する。

(2) 本誌に投稿された論文、資料及び記事は「私信」とし、これらの内容の審査は原則として行わない。但し、運営委員会が論文及び記事の内容について本誌目的から著しく逸脱していると判断した場合には掲載を拒否することがある。

※本誌に掲載された論文及び資料を他の学術雑誌等に引用する場合は著者の承諾を得ること。

※掲載する内容 (特に図、写真) は既に学会誌等へ発表したものでも差し支えない。しかし、本報告に掲載された内容は、学会誌によっては既報のものともみなされる場合があるので、二重投稿にならないように各自、留意するように。

2. 英文報告、和文報告とも著者の原稿をそのまま印刷しますので、次の執筆要領を守って頂くようお願い致します。(英文・和文のいずれかの提出で結構です)

	英 文 (推奨)	和 文
用紙の大きさ	A4 版、白 上下各 2cm 左右各 1.5cm の余白	
枚数	2 枚 (*注)	2 枚
書式、フォント、サイズ等	様式 3-1 に従ってください	様式 3-2 に従ってください

*注 : HVEM Project に係る報告書は、英文 4 枚以上

3. 報告の内容

(1) 研究の概要を目的、方法、結果がわかるように書いてください。

(2) 表題等につける場合には番号及び記号は次の優先順位で記入してください。

1、(1)、a)、以下自由。

(3) 英文和文報告とも、図、表、写真等、およびその説明文は英文にしてください。

和文原稿の場合は、英文タイトル、英文著者名を別途記入してください。文中の図及び写真は通し番号として Fig.1, Fig.2…を用い、また表は Table 1…としてください。

(4) 文章の終わりは和文もピリオド (.) にしてください。図等の説明文、参考文献の終わりもピリオドに統一します。

- (5) 図及び写真は縮尺を考慮して各自、原稿に貼りつけてください。
- (6) 研究に使用した装置名を列記してください。（装置名は次ページを参照）
- (7) 参考文献はこの研究に関する資料を提供することを主目的にしています。従って、この研究に関する著者の資料を中心にして、卒業論文、修士論文、及び口頭発表の講演概要集等も掲載することが望ましいです。本文中の肩に引用番号¹⁾、²⁾、^{3~5)}をつけ、原稿の最後に引用番号順に従って、引用番号、著者名、雑誌名（書名）、巻、年号、頁を記載してください。（例参照）
ただし、英文の場合は原稿例の様な書き方で結構です。

〈原稿例〉

- [1] C. Kinoshita, T. Mukai; Bulletin of the Japan Institute of Metals, **20** (1981) 370. (in Japanese).
[2] T. Mukai, C. Kinoshita, S. Kitajima; Phil. Mag., **A47** (1983) 255.
[3] C. Kinoshita, T. Mukai, S. Kitajima; *Point Defects and Defect Interactions in Metals* (Ed. K. Takamura et al.), Publisher, 1982, P. 857.
[4] C. Kinoshita, T. Mukai, S. Kitajima; Proc. the Tenth Int. Cong. on Electron Microscopy, 1982 p. 471.

【4】 令和 5(2023)年度の電子顕微鏡に関連した学位取得状況・各賞受賞者状況リスト
(様式 4)

上記リストの作成にご協力お願い致します。

【すべての発表について】

超顕微解析研究センターを利用して行った研究成果を学会等へ発表する場合には、その旨を明記して頂くことになっています。その場合、センター名、機種名は和文、英文の場合ともそれぞれ次のように統一いたしますのでご協力ください。

〈センター名〉

九州大学超顕微解析研究センター
The Ultramicroscopy Research Center Kyushu University

〈機種名〉

超高压電子顕微鏡：JEM-1300NEF
新高分解能電顕：JEM-ARM300F2
収差補正走査/透過電子顕微鏡：JEM-ARM200F
広電圧超高感度原子分解能電子顕微鏡：JEM-ARM200CF
三次元観察電子分光型電子顕鏡：JEM-3200FSK
ローレンツ電子顕微鏡（筑紫）：Tecnai- F20
補助電子顕微鏡：JEM-2000EX
HC 補助電子顕微鏡：JEM-2100HCKM
マイクロカロリメーター高エネルギー分解能分析装置：TES + ULTRA55
デュアルビーム FIB：Quanta 3D 200i
ホログラフィー電子顕微鏡：HF-3300X
直交型 FIB-SEM：MI4000L

※その他は超顕微解析研究センターHPをご確認ください